倒置
金相顯微鏡

EN-MI2系列	
	EN-MI200
觀察鏡筒	傾斜45°三眼鏡筒，瞳間距54~75mm,單眼視差調整
光學系統	獨立校正色差光學系統, 分光系統50%/50%
目鏡	WFPL 10X/18mm
鼻輪	倒置五孔鼻輪
物鏡	長工作距離平場金相物鏡 5X/N.A.0.13/W.D.15.5mm 長工作距離平場金相物鏡 10X/N.A.0.25/W.D.8.7mm 長工作距離平場金相物鏡 20X/N.A.0.40/W.D.8.8mm 長工作距離平場金相物鏡 50X/N.A.0.60/W.D.5.1mm 長工作距離平場金相物鏡 100X/N.A.0.80/W.D.2.1mm
放大倍率	50X ~1000X
調焦裝置	粗細同軸調焦裝置(粗調節範圍15mm細調格值0.002㎜) , 內建調焦鬆緊裝置
載物台	180X155mm雙層機械導軌平台，X / Y軸移動行程75 X 40 mm,
聚光鏡	N.A. 1.25 聚光鏡
照明系統	上下光源 3W LED光源
附件	保固卡, 防塵套, 防碰撞泡綿紙箱
選配	平版操作系統、電子目鏡
尺寸重量	195mm x 288mm x 329mm，-kg

■ 光學系統

複消色光學系統, 對工業檢測提供完整的明場消光檢測

■ 偏光系統

附有簡易式偏光裝置, 在濾色裝置的輔助下, 能更完善的呈現

■ 同軸光系統

特有落射同軸光系統, 多功能的偏光與濾色功能

■ 機身構造

以輕量化做為基底概念, 並附有二側護板供使用者, 手肘放置

EN-MI200